(54), SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(11) 62-162355 (A) (43) 18.7.1987 (19) JP

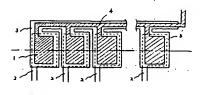
(21) Appl. No. 61-4481 (22) 13.1.1986

(71) SEIKO EPSON CORP (72) MASABUMI KUNII(6)

(51) Int. Cl⁴. H01L27/14,H04N1/028

PURPOSE: To inhibit the disconnection of upper electrodes and the generation of crack by making larger the area of lower electrodes than that of the upper electrodes.

CONSTITUTION: In a solid-state image pickup device provided with upper electrodes 1 and lower electrodes 2 formed across an amorphous semiconductor layer 3 on an insulating substrate 5, the area of the electrodes 2 is formed larger than that of the electrodes 1 and also, the amorphous semiconductor layer 3 is provided under each upper electrode lead-out part 4. Thereby, the length of stepped parts of the electrodes 1 is made shorter and also, the stepped configuration of the stepped parts is relaxed, and the disconnection of the electrodes 1 and the generation of crack and so on can be inhibited.





(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(11) 62-162356 (A) (43) 18.7.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 61-207683 (22) 5.9.1986

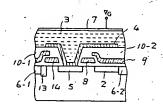
(71) TOSHIBA CORP (72) NOZOMI HARADA

(51) Int. Cl4. H01L27/14,H04N5/335

PURPOSE: To prevent the deterioration in color reproducibility or to prevent signals of dark parts from not appearing by arranging an N-type drain layer arranged on a P-type Si substrate and an overflow control electrode for controlling a surface

potential of the substrate between said drain layer and an N-type layer.

CONSTITUTION: A drain N⁺⁺ layer 13 which is adjacent to an N⁺ layer 5 and is used as an overflow drain and an overflow control electrode 14 for controlling a surface potential of a substrate 1 between said layers 13 and 5 are arranged. During a storage duration subsequent to a signal read-out duration, a transparent electrode 7 is kept at higher level than the surface potential of the layer 5 for an arbitrary duration. Then, it is kept at lower level voltage for storing the next signal charge. In the initial period of that, the potential of the electrode 14 is changed into that of high level and the potential of the layer 3 is changed into that of low level, thereby implanting the charges into the layer 5 from the layer 13 so as to determine a surface potential of the layer 5. Thus, a voltage which leaves the signal charges in the layer 5 is applied and nextly an insufficient quantity of charges is implanted from the layer 13, thereby preventing the phenomenon that the signals of dark parts of an object do not appear as outputs.



(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE (11) 62-162357 (A) (43) 18.7.1987 (19) JP

(21) Appl. No. 61-207684 (22) 5.9.1986

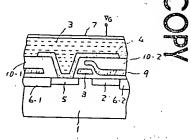
(71) TOSHIBA CORP (72) NOZOMI HARADA

(51) Int. Cl4. H01L27/14, H04N5/335

PURPOSE: To enable the easy automatic adjustment of sensitivity by changing a voltage to be applied to a transparent electrode with time in the structure in which an amorphous semiconductor layer is arranged on a signal read out part made of an Si single crystal substrate.

CONSTITUTION: On a P-type semiconductor substrate 1, an N⁺ layer 2 as a signal charge transfer part of a CCD and an N⁺ layer 5 connected with an amorphous semiconductor layer 3 through a metallic electrode 4 are formed. P⁺ layers 6-1 and 6-2 are arranged adjacently to the layers 2 and 5. On the layer 3, a transparent electrode 7 is formed. The signal charges photoelectrically converted in the layer 3 are transferred to the layer 2 and are read out by applying a voltage to a read-out gate electrode 8 adjacent to the layer 5. Also, the electrode 8 and a transfer electrode are surrounded with insulating films 10-1 and 10-2. In this constitution, a voltage to be applied to the electrode 7 is changed with time. Namely, a low-voltage duration after retaining a voltage of the seminary and the surrounded with time.





①特許出頭公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 162356

@Int Cl.4

證別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)7月18日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335 7525-5F -8420-5C

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

砂発明の名称 固体摄像装置

> ②特 豠 昭61-207683

四出 願 昭55(1980)8月27日

@特 題 昭55-116945の分割

②発 明 者 原 \mathbf{H}

川崎市幸区小向東芝町1 望

株式会社東芝総合研究所内

包出 顋 人 株式会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地

沙代 濢 弁理士 則近 憲佑

外1名

畊 31

発明の名称

固体凝像装置

2、 特許請求の範囲

P型シリコン基板と、この基板に設けられた一 対のN型層と、このN型層間上に絶縁膜を介して 設けられたゲート電圧と、このゲート電極と絶紋 戦を介して離間し且つ前記N型間の一方のN型刷 上に絶縁膜を介して設けられた転送電極と、前記 ゲート電極選下以外のP型シリコン装板内に前記 N型別と離間して設けられたPP型別と、前記N型 型の他方のN型階側のP*型層に隣接して設けられ たN型ドレイン間と、このN型ドレイン間と他方 のN型圏同上に絡放販を介して設けられた制御は 極と、前記地方のN型周上に直接着しくは銀気的 に投触し且つ前記ゲート間極及び転送配極上に絶 綾殿を介して設けられたアモルファスシリコンか らなる光電変換層と、この光電変換層と前記値方 のN型別間に設けられた飢饉別と、前記光電変換 母上に設けられた光を遊過する透明電機とを解え

たことを特徴とする固体顕像施設。

3、 発明の詳細な説明

本発明は固体操係装置に関する。固体機像装置 において光電変換を従来のシリコン(S1)単結品基 板で行うのでなくアモルファス半導体別で行うも のが知られている。そしてこれは倡号級出し部に 従来のSi単結品装板を用いている。このSi単結品 基板による信号統出し部上に前記アモルファス半 選体層があるため2階鍵センサと呼び従来のSi単 結晶基板のみによる固体遊像数型とは分けられる。 本発明はこの2階建センサと称される箇体過像数 徴に係るもので、自動感度調整を行えるようにし た関体設像装置に関する。

第1回は本発明者が先に提案した自動態度調整 方法を説明するためのものである。ここでは設出 し部にCCD(Charge Coupied Device) を用いた 羧酸を用いて説明を行う。例えば第1図(a)に示 されるようにp型半導体恭仮の上にCCDの信号 位荷伝送部である第1のN+ 層囟とアモルファス半 選体月間と金属単極側で接続された第2のN*月目

がある。そして前記第1のN*別のと第2のN*別の に隣接してチャンネルストッパである P 暦(6-1,6 -2)がある。又、前記アモルファス半導体層の上 に透明遺植のがある。そして前紀アモルファス半 選体層ので光電変換された信号離荷(電子)は、 第2のN*周句に隣接した設出しゲート電框内に低 圧を印加することによって前記第1のN*層に転送 させて放出す。ここで第1のN*型切上にはCCD の転送電極切がある。そして前記放出しゲートは 極間と転送電極間の別聞は酸化膜による絶縁膜 (10-1, 10-2) が存在している。そしてこの透明 低極のに印加されている低圧をVaとして、前記第 2のN*別句表面配位をVnとする。前記金属遺植(4) と透明覚極切ではさまれたアモルファス半路体別 切は1つのダイオードと等価的に記述することが できる。そして、このアモルファス半導体別のの 両端に同図(b)に示すようにVaとVnが印加されて いる。第1図(a)において放出しゲート燃極例に 電圧を印加して付号難荷を読出した直後のVnをVn 0とする.

ス状態となり信号館荷のCCDへの転送が確実に 行なわれる。

以上説明したようにこの方式によれば、透明で 極に印加する低圧を時間的に変化することによっ て容易に自動感度関弦を行うことができる。

動上の問題というとは、 がある。には、 があるででは、 があるででは、 があるででは、 があるででは、 がいるででは、 がいるでででいるが、 がいるででは、 がいるでででいるが、 がいるでででいるが、 がは、 がいるでででいるが、 がは、 がいるでででいるが、 がは、 がいるでででいるが、 がは、 がいるでででいるが、 がは、 がいるででいるが、 がは、 がいるででいるが、 がいるが、 がいるででいるが、 がいるが、 がいるでいるが、 がいるででいるが、 がいるが、 がいるででいるが、 がいるが、 がいが、 がいるが、 がいが、 がいが、 がいが、 がいるが、 がいが、 がいるが、 がいるが、 がいが、 がいが、 がいるが、 がいるが、 がいが、

ここで同図(a)に示すように透明電優のに印加 する電圧Voを時期的に変化させる。即ち信号電荷 を統出すための信号統出し期間と信号電荷を容積 するための潜積期間より1周側を構成する過級動 作において前記信号説出し期間に連続した任意の 期間、Vaを前記Vao に保持せしめ、その残りの期 間前記Vnoより低電圧Vzにする。そしてこの低電 圧期間Txを入射光量に応じて変化せしめることに よって自動感度調整を行う。ここにおいてはヒェは 阿図(a)においてアモルファス半導体圏の及び前 記第2のN*間によるダイオード容量に設議された 信号電荷が前記CCDの第1のN+原図にオーバー フローしない電圧である。以上説明したように芳 祇期間の内Vno 保持期間においては前記アモルフ ァス半導体型のによるダイオードに 飲圧が印加さ れていないため信号超荷の蓄積が行なわれない。 そして低度圧Vr保持期間においてのみ信号電圧語 税を行うことができる。又、信号電荷説出期間に はVaを負電圧にすることによって確実に前記アモ ルファス半導体層間によるダイオードが逆パイア

の低に対しても、実際化学ではは少ないにしても、実際化学を関係しても、実際化学を関係しても、実際化学を関係しているのではないがある。 カメないの はいいない はいい かっという はい い い はい か は は ない ない は は ない ない は は ない ない は は ない ない は は ない は は ない は ない は ない は は ない はい は ない はい は ない は ない はい はい はい はい は

野2図を用いてこの現象について説明する。同 図(a)は第1図(a)に示した個体操像と置の1セル部分の断面構造図である。 閉図(b), (c), (d), (o) はこのセル構造において前記の透明電極切に Vnaより高レベル健圧が印加された際の駆動 選圧 波形による信号電荷智観の時間的変化を説明する ための半導体基板(1) 設価での電位分布図である。

(b)は何号電荷流出し期間後透明征極切に Vno

より高レベル健圧が印加されている原の健位分布 を示している。ここで点線で示したものは前記第 2のN*層句部の信号電荷統出し動作終了後の配位 であり、その値は V noである。ここで前述したご とく透明電低切にVnoより高レベル世圧を印加す ることによって前記第2のN*別向にある駐荷(旺 子) の透明電圧切べの流出が発生し、該類2のN* 周 匂の 表面 電位は前記 Vnoより高レベルに設定さ れる。そしてこの高レベル独圧保持期間において は前記アモルファス半導体層ので発生した信号は 荷(憶子)は透明電極の個へ流出し信号電荷薔薇 は行なわれない。次に透明気援切に信号電荷を習 税するための常圧Vzを印加すると俳号電荷が潜積 される。このVェ保持期間においては、周囲(c)に 示すようにアモルファス半導体層の内で光風射に より発生した信号電荷が層内を走行して金属電機 4)に到達し、前記第2のN*層向の間位を低下させ る。そして、次の信号は荷を説出すために前記説 出しゲート電極側に触圧を印加して信号電荷のC CDの第1のN*層四への転送を行う場合の間位分

市を同図(d)に示す。ここで前記歳出しゲート社 機関下の半導体基板() 表面健位は V Noであり、そ のためこの読出しゲート地径(四に印加された) 健 により決められた理位 V Noより 単位的に低い 他 を持った信号 唯荷(11)は C C D の第1の N+ 短 〇 へ 低送されるが、それ以上の単位を持った 信号 単 (12)は転送されなく 例図(e)に示すように 第2の N+ 層 同に残存してしまう。

本発明は上記の点を堪みなされたものである。即ち本発明は前述した信号批荷統出し期間に続いて前記透明電極のに印加すべき電圧が正確に行なわれないために発生する例えばカラー協像における色再現性の劣化又は協像被写体の暗い部分の信号が出力として現われないごとき問題を防止し、かつ越度調整を行う固体協像装置を提供することを目的とする。

第3図を用いて本発明の一支施例を説明する。 同図(a)は本発明を説明するための四体操像装 型の1セルの所面構造説明図である。第1図(a) と異なるところは第2のN*型のに群接して従来の

固体協働装置においてオーバフロードレインとし て用いられているドレイン N ** 暦 (13)と該ドレイ ンN++暦(13)と前記N+層句間の半導体接板①表面 単位を制御するためのオーバフロー制御包極(14) が設けられているところである。そして同図(b) に透明危極のに印加する就圧Va、オーパフロー制 御袋鼠(14)に印加する地圧 ¢ora . オーパフロー ドレイン(13)に印加する電圧 ¢ of o の電圧波形を 示す。これに示すように信号統出し期間に続いて 潜 祇 期間 において 透明 電極 切は前 記 Vnoより 高 レ ベルに任意の期間保持する。そして次の信号電荷 を替積するためVnoより低レベルの低圧Vzに保持 する。このVェ世圧の保約期間の初期において ψ opgを Vaから高レベル低圧Vcに変化せしめ、そ してゅoppをVoからより低レベル低圧Vgに変化せ しめることによって健荷(健子)をオーパフロー

ドレイン(13)より前記第2のN*層向へ注入して、

この男2のst 胆匀の表面低位を foraの電圧 Vcで

(14)に印加する電圧Vcは朔関(a)の設出しゲート

設定せしめる。そして、オーバフロー制御電抵

第4 関を用いてこの動作説明を行う。同図(a)は第3図(a)と同じ周体場像設置の1セル斯面構造であり、同図(b),(c),(d),(e)はこの所面構造における半導体基板の製面部の単位分布の時間変化を示す。同図(b)は信号説出し期間に続いて透明世橋のに V Noより高レベル 社 E V A を 印加しているときの単位分布を示す。この場合第2のN+ 別

四の代荷は一部透明は極側に流れ出て、その第2 のN+附向の電位は前記 V Noより高くなっている。 そして、次にVaを信号取荷を遊積するための地圧 Vェに保持したその初別においてすoraを VaからVc へ、そしてゅoroをVoからVBへ変化せしめたとき の唯位分布を同図(c)に示す。ここにおいてはオ ーパフロードレイン(13)から第2のN+原向へ選荷 (16)の注入を起り、次にφopo を元の間圧Voに戻 すことによって同関(d)に示すようにオーバフロ 一制御鐵極(14)に印加した離圧Vcにより決められ る電位Vnoが除漿となり、これにより決められる 雄荷(15)が増2のN*層向に残存することによって 数第2のN→層向の配位はVnoに固定される。そし て、次に同凶(a)に示すようにオーパフロー制御 電悟の電圧 ¢ opaが V oに 戻ることによって信号電 荷の潜積が行なわれる。これによって、従来の方 法より更に確実に前記第2のN*層向の電位設定を 行うことができる。

第5回を用いて本発明のその他の一実施例を説明する。これは第3回、第4回を用いて説明した

によれば近接した2つの電極、オーバフロー制御 徴帳(14)と読出しゲート電便側に印加する電圧を 周じにし、そしてオーバフロードレイン(13)より 遺術注入を行うことによって必度調整を行うため の潜程期間の初期期間前記第2のN*用筒の電位が 前記Vnoより高くなったのをVnoに戻している。 この方式は前記號出しゲート電極圏とオーパフロ 一制御は極(14)下の半導体基板(1)表面のは気的性 **愛がほぼ囲等であることを利用しており、前記**郊 2のN+別国電位設定を容易にしている。しかし上 記憶気的性質が全く同一でない殴り、これによる 不具合が非常に少ないが発生する可能性がある。 これに対して第5図(a)に示すごとく信号説出し 期間において読出しゲート電極(14)に印加する※1 圧Vcより低レベル電圧Vnを、オーパフロー制御電 裾(14)に、 第 3 図(a)に示したVaがVaからVzに変 化した初期期間印加する。これによって同図(16) に示す電位分布のごとく第3図の方式において

本作明の一方法より更に望ましい方法を提供する

ものである。即ち、郊3図、郊4図における方式

VNoによって決められる荷量(15)に更に電荷(17)が加わったものが前記第2のN+層間に残存される。この方式によれば前述したような撮像被写体の暗い部分の信号が出力として現われないごとき現象は発生せず、そして本方式によれば各セルが一定量の電荷(17)に加えて信号電荷の容積が行なわれるため信号量の少ない被写体の場所の色再現性が悪い問題も発生しない。

以上説明したごとく、本売明は従来の固体扱像 装置で問題となる例えばカラー撮像における色再 現性の劣化又は損像被写体の暗い部分が出力とし て現われないごとき現象を防止することができる。

なお実施例では透明電極に関政状の電圧を印加したものについて述べたが、従来例と同様パルス 又は正弦波電圧を印加してもよく、そして容積期間において信号電荷を設積するためのYェ保持期間、例えば競敗状义は時間的に連続的に変化する電圧 を印加して感度調整及び光低変換特性の2つの制御を同時に行うようにしてもよい。

れゃ しな変体はにセけるフェルフェス半波体

層切は単層のごとくして説明したが複数層より形 成されるものでも何らかまわない。そして本発明 は信号電荷説出し部としてCCDを用いて説明を 行なったが、例えばBBD(Bucket Brigade Device) であってもよい、即ち本免明は信号許額 と観出しにより1周期を構成する"2階建センサ" に対して選用できるものでCCDにとらわれない。 そして、本発明は1次元及び2次センサ共に適用 できることは貫うまでもない。又、夾筋例として アモルファス半導体層間を透明電極切と金属電極 似によりはさんだ、前記アモルファス半導体が同 の耳さ方向の特性を利用したものについて説明を 行なったが、横方向性質を利用したものにも本発 明が適用できることは言うまでもない。又、適明 健性切として単一のものについて説明したが、沒 数により制御することも可能である。

4. 関面の簡単な説明

第1図、第2図は従来例を説明するための図、 第3図乃至第5図は各々本発明の実施例を説明するための図である 1:p型半導体基板、 2:第1のN*層、

3:アモルファス半導体灯、

4: 游体電極 (第1の源体電極)

5:第2のN*間、 6-1,5-2:p*層、

7:透明電優(第2の導体電係)、

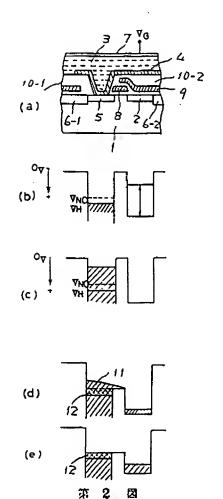
8:統出しゲート城極、 9:00日転送電極。

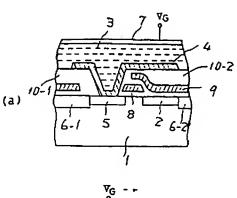
10-1,10-2: 絕級獎、 l1,12: 借号維荷、

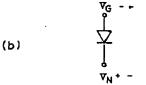
13:オーパフロードレイン、

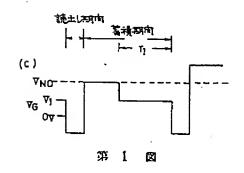
14:オーパフロー制御電視、

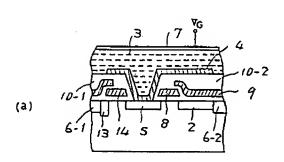
15.16:オーバフロードレインからの注入電荷。

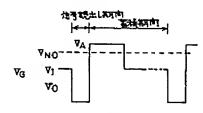


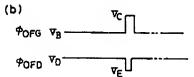


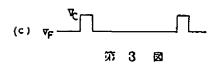




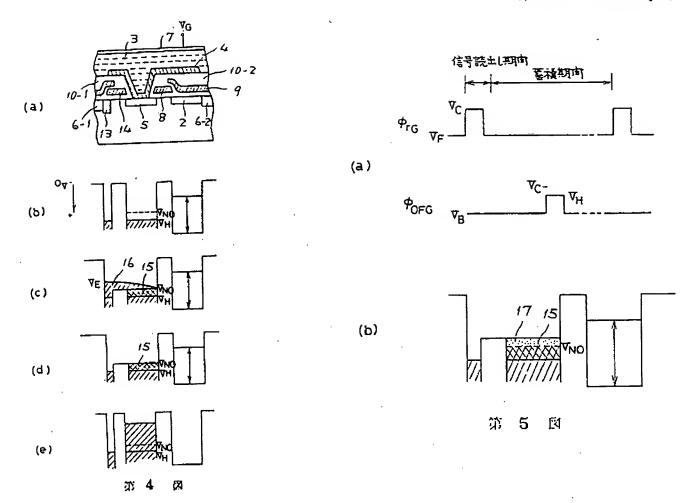








特開昭62-162356(6)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.